BEST AVAILABLE COPY

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

PATENTSCHRIF1



(12) Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(18) DD (11) 242 429 A1

4(51) C 22 F 3/00 C 21 D 1/00

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlich

(21)	WP C 22 F / 243 680 7	(22)	30.09.82	(44)	28.01.87
(71) (72)	Akademie der Wissenschaften der DDR, 1080 Berlin, Otto-Nuschke-Straße 22/23, DD Finn, Thomas; Heß, Helmut, Dr. sc. DiplPhys.; Kerkow, Hartmut, Dr. rer. nat. DiplPhys.; Kudelle, Frank, I rer. nat. DiplPhys.; Metzke, Eckhard, DiplIng.; Schreck, Hans-Joachim, DiplPhys.; Wirsig, Manfred, DiplPhys., DD				
(54)	Verfahren zur Materialeigenschaftsänderung				

(57) Das Verfahren kann dort angewendet werden, wo eine bessere Anpassung der Eigenschaften der Materialien an die Einsatzbedingungen erreicht werden soll, z. B. in Form erhöhter Härte, Festigkeit, verbesserter Kristalistruktur. Das Ziel der Erfindung ist es, eine gleichmäßige Veränderung der Eigenschaften von oberflächennahen Bereichen und/oder im Volumen in bellebig geformten Körpern aus unterschiedlichen Materialien zu erreichen. Die Aufgabe besteht darin, eln Verfahren zur definierten Beeinflussung der Oberflächen- und/oder Volumeneigenschaften unterschiedlicher Materialien anzugeben. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Materialien einem durch annähernd adiabatische Kompression erzeugten impulsförmigen, stark strahlenden, dichten Flasma ausgesetzt werden.

ISSN 0433-6461

3 Seite

Erfindungsanspruch:

- 1. Verfahren zur Materialeigenschaftsänderung im oberflächennahen Bereich und Im Volumen, gekennzeichnet dadurch, daß die Materialien einem durch annähernd adiabatische Kompression erzeugten impulsförmigen, stark strahlenden, dichten Plasma ausgesetzt werden und die Veränderung der Oberflächen- und Volumeneigenschaften durch einzelne oder kombinierte Einwirkung von Druck, Wärmeleitung, Strahlung, Einbau von Fremdatomen bzw. innige Verbindung aufgebrachter Schichten mit dem Werkstoff erfolgt.
- 2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß zur Erzeugung des Plasmas eine Kolben-Zylinder-Anordnung
- Verfahren nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß die Plasmaparameter durch Verlation der Rohrlänge, des Rohrdurchmessers, der Kolbenenergie, der Gasert, des Anfangsdruckes und der Anfangstemperatur des Gases eingestellt
- 4. Verfahren nach Punkt 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch, daß die Plasmaparameter Druck bis oberhalb 1 GPa und Temperatur bis 20000K variiert werden und die Halbwertsbreite des Druckimpulses zwischen einigen 10 µs und einigen ms liegt.
- 5. Verfahren nach Punkt 1 bis 4, gekennzeichnet dedurch, daß das zu behandelnde Material nur der Strahlung des Plasmas
- Verfahren nach Punkt 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß zum Zwecke des Einbaus von Fremdatomen in das zu behandelinde Material auf dem Material von der Plasmaeinwirkung eine die Fremdatome enthaltende Schicht aufgebracht wird und/oder ein Arbeitsgas verwendet wird, das die Fremdatome enthält.
- 7. Verfahren nach Punkt 6, gekennzeichnet dadurch, daß eine innige Verbindung zwischen einer von der Plasmaeinwirkung aufgebrachten Schicht und dem Werkstoff hergestellt wird.

Anwendungsgebiet-der Erfindung

Das Verfahren kann dort angewendet werden, wo durch gezielte Änderungen der Oberflächen- und Volumeneigenschaften von Materialien mittels Einwirkung von Druck-, Strahlungs- und Wärmeimpulsen, Einbau von Fremdatomen bzw. innige Verbindung vorher aufgebrachter Schichten mit dem Werkstoff eine bessere Anpassung der Materialien an die Einsatzbedingungen erreicht werden soll, z.B. in Form erhöhter Härte, Festigkeit, verbesserter Kristallstruktur, Korrosionsbeständigkeit oder Rißunempfindlichkeit.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Verfahren zur Beeinflussung von Oberflächeneigenschaften durch Strahlungsimpulse aus Lasern sind in DD-WP 141378, DE-OS 3007 160, DE-OS 2740 569, EP 0035 401, US-PS 3850 698 und US-PS 4122 240 beschrieben. Die Laserbehandlung großer Oberflächen hat aber den Nachteil des kleinen Brennfleckes, was Vorrichtungen zur Rasterung und lange Behandlungszeiten

Die Beeinflussung der Eigenschaften von Halbleitermaterialien durch Strahlungsimpulse aus Hochleistungslampen (DD-WP 147980) bzw. von metallischen und dielektrischen Materialien durch gepuiste Lichtstrehlen (US-PS 4229232) ist nur anwendbar, wenn die abgestrahlte Energiedichte der Lampen ausreichend ist. Die Lampen haben darüber hinaus nur eine

Laser und Hochleistungslampen haben weiterhin den Nachteil, daß auf Grund der notwendigen optischen Fenster keine hohen

Photonehenergien verfügbar sind.

Bekannt ist auch die Anwendung eiektrischer Entladungen zur Veränderung von Materialeigenschaften (z. B. DD-WP 59940, DD-WP 151 635, DE-AS 1408930, DE-OS 2449712). Diese führen bei hoher Energiedichte zu unerwünschten Änderungen der Oberflächengeometrie. Bei geringer Energiedichte sind lange Behandlungszeiten notwendig; und Oberflächeneffekte, die auf Abschreckung beruhen, sind infolge Volumenerwärmung nicht erzielbar.

Die Veränderung von Materialeigenschaften durch Druck- und Wärmeimpulse wird in DE-AS 2436951, DE-OS 2119766 und EP O 022433 beschrieben. Diese Patente beziehen sich aber auf die Herstellung kompakter Teile aus Pulvermaterialien unter Ausnutzung der Ernergie von Stoßwellen. In US-PS 3 157 498 wird ein Verfahren vorgestellt, das mit einem durch einen explosionsgetriebenen Kolben adiabatisch komprimierten Gas arbeitet und zum Sintern von Pulvermaterialien dient. Weiterhin wird die Druck- und Temperaturerhöhung in durch Kompressoren verdichteten Medien zur Herbelführung chemischer Reaktion genutzt (z.B. GB-PS 1387386, DE-AS 1275237).

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine gleichmäßige Veränderung der Eigenschaften von oberflächennahen Bereichen und/oder im Volumen in beliebig geformten Körpern aus unterschiedlichen Materialien zu erreichen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur definierten Beeinflussung der Oberflächen- und/oder Volumeneigenschaften unterschiedlicher Materialien anzugeben. Das Verfahren soll eine schneile Beeinflussung beliebig geformter Körper

ermöglichen. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Materialien einem durch annähernd adlabatische Kompression erzeugten impulsförrnigen, stark strahlenden, dichten Plasma ausgesetzt werden und die Veränderung der Oberflächen- und Volumeneigenschaften durch einzelne oder kombinierte Einwirkung von Druck, Wärrneleitung, Strahlung, Einbau von Vremdatornen bzw. Innige Verbindung vorher aufgebrachter Schichten mit dem Werkstoff erfolgt, wobei die Plasmaparameter

Variabet Sinu.

Zur Erzeugung des Plasmas wird ein ballistischer Kompressor in Form einer Kolben-Zylinder-Anordnung verwendet. Nach Zur Erzeugung des zu beeinflussenden Materials in den Zylinder wird das als Kompressionsraum dienende Rohr verschlossen, Einbringen des zu beeinflussenden Materials in den Zylinder wird das als Kompressionsraum dienende Rohr verschlossen, evakulert und ein Arbeitsgas in das Rohr eingefüllt. Bei anschließender schneiler Freigabe einer gespelcherten Energie wird dem evakulert und ein Arbeitsgas annähernd adlabatisch Kolben ein Impuls erteilt, der ihn so beschleunigt, daß das im Zylinder befindliche Arbeitsgas annähernd adlabatisch Kolben ein impuls erteilt, wobei ein starkstrahlendes, dichtes Plasma entsteht. Durch Variation der Rohrlänge, des Rohrdurchmessers, der Kolbenenergie (Masse und Geschwindigkeit), der Gasart, des Anfangsdruckes und der Anfangstemperatur des Gases sind die zu erreichenden Kombinationen von Druck-, Strahlungs- und Wärmeimpuls steuerbar, wobei Drücke bis oberhalb 1 GPa, die zu erreichenden Kombinationen von Druck-, Strahlungs- und Wärmeimpuls steuerbar, wobei Drücke bis oberhalb 1 GPa, die zu erreichenden Kombinationen von Druck-, Strahlungs- und Wärmeimpuls steuerbar, wobei Drücke bis oberhalb 1 GPa, die zu erreichenden Kombinationen von Druck-, Strahlungs von einigen 10 µs bis zu einigen ms wählber sind. Temperaturen bis etwa 20000 k und Halbwertsbreiten der Druckimpulse von einigen 10 µs bis zu einigen ms wählber sind. Temperaturen bis steuerbar, wöhlt unmittelbar auf das zu behandelnde Material und verändert dessen Oberfläche bis in Die Strahlung des Plasmas sehr homogen, das Material wird daher Schichttiefen von 0,1 bis 100 µm. Infolge des Verlaufes der Kompression ist das Plasma sehr homogen, das Material wird daher Schichttiefen von 0,1 bis 100 µm. Infolge des Verlaufes der Kompression ist das Plasma sehr homogen, das Material wird daher Schichttiefen von 0,1 bis 100 µm. Infolge des Verlaufes der Kompression ist das Plasma sehr homogen, das Material wir

Auch die durch Wärmeleitung auf das zu behandelnde Material übergehende Energie und die kurzzeitige, hohe Druckbeaufschlagung beeinflussen die Oberflächen- und Volumeneigenschaften des zu behandelnden Materials. Durch die Wahl des Arbeitsgases und/oder durch vorheriges Aufbringen von Framdatome enthaltenden Schichten erfolgt der Einbau von Fremdatomen in das zu behandelnde Material, und es kann eine innige Verbindung zwischen einer vorher aufgebrachten Schicht und dem Werkstoff hergestellt werden.

Weil die Energiezufuhr impulsförmig erfolgt, frieren die bei hoher Temperatur entstandenen Strukturen bei Abbruch der Weil die Energiezufuhr infolge der hohen Abkühlungsgeschwindigkeit der Oberflächenschicht ein. Energiezufuhr infolge der hohen Abkühlungsgeschwindigkeit der Oberflächenschicht ein. In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind Materialien, die nur einer intensiven Strahlung ohne Druckbeaufschlagung ausgesetzt werden sollen, außerhalb des Kompressionsraumes hinter einem optischen Fenster angeordnet.

Ausführungsbeispiel

Eine Stahlprobe wurde in der mit Argon gefüllten Kammer einer Kolben-Zylinder-Anordnung einem Druck von 300MPa und einer schwarzen Strahlung von ca. 17 000 K direkt ausgesetzt. Druck und Strahlung wirkten etwa 100 µs auf die Probe. Es wurde eine Zunahme der Oberflächenhärte um den Fektor 4 auf ca. 1 000 kp/mm² erreicht. Die Dicke der ausgehärteten Schicht beträgt einige 10 µm.